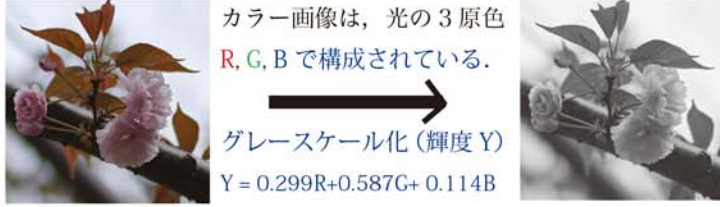
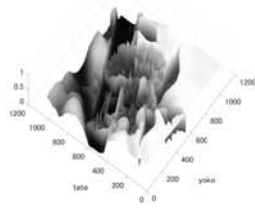


画像のエッジ抽出について

グレースケール化



左図を斜め上から見ると右図になる。画像は平面メッシュ上の関数である。メッシュをピクセルとよぶ。



フーリエ変換で平行移動とエッジ抽出

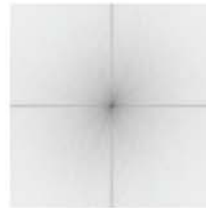
実数 x, y に対して、

$$e^{x+yi} = e^x e^{yi} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

フーリエ変換

絶対値 log スケール ネガ

周期的な平行移動になる。移動単位は実数で良い。



100.3 pixel 上へ
60.2 pixel 右へ



0.6 pixel 右へ
0.8 pixel 下へ
差を取る

下図は、フーリエ変換を使ったエッジ抽出である。周期的な平行移動なので、上辺と底辺、左辺と右辺の値が異なり、人為的なエッジが生まれるため、画像の端で大きい値になる。ネガの絶対値の平方根を log スケールで描いた。



エッジ (画像の輝度が急に变化する部分)



元画像を少し動かして、差を取ると、動かした方向と垂直なエッジを抽出する。左図が縦エッジ、中図が横エッジ、右図が斜めエッジに対応する。縦エッジの2乗と横エッジの2乗の和の平方根を描くと右図になる。ピントの合っていない左下部分はモヤモヤしている。ネガの絶対値の平方根を log スケールで描いた。

フーリエ変換・逆変換と平行移動・微分

画像 $f(x_1, x_2)$ に対して、フーリエ変換と逆変換を

$$\hat{f}(\xi_1, \xi_2) = \int_{\mathbb{R}^2} f(x_1, x_2) e^{-i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)} dx_1 dx_2$$

$$f(x, y) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} \hat{f}(\xi_1, \xi_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)} d\xi_1 d\xi_2$$

で定義する。このとき、平行移動と x_1 方向偏微分は

$$f(x_1 - c_1, x_2 - c_2) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-i(c_1\xi_1 + c_2\xi_2)} \hat{f}(\xi_1, \xi_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)} d\xi_1 d\xi_2$$

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} i\xi_1 \hat{f}(\xi_1, \xi_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)} d\xi_1 d\xi_2$$

である。

$$1 \text{ 階微分} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2} \hat{f}(\xi_1, \xi_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)} d\xi_1 d\xi_2$$

$$2 \text{ 階微分} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} (\xi_1^2 + \xi_2^2) \hat{f}(\xi_1, \xi_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)} d\xi_1 d\xi_2$$

1 階微分の絶対値の平方根
ネガ log スケール



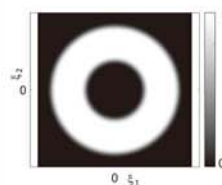
2 階微分の絶対値の平方根
ネガ log スケール



$$\text{バンドパス} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} BP(\xi_1, \xi_2) \hat{f}(\xi_1, \xi_2) e^{i(x_1\xi_1 + x_2\xi_2)} d\xi_1 d\xi_2$$

バンドパスの絶対値の平方根, ネガ log スケール

BP



参考文献

R. Ashino, S. Kataoka, T. Mandai, and A. Morimoto, Blind image source separations by wavelet analysis, Appl. Anal., Vol. 91 (4), 617 - 644, 2012.

A. Morimoto, R. Ashino, T. Mandai, An Estimation of Rotation And Translation In Image Separation Problem, in the Proceedings of the 2018 International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition, Chengdu, China, 15-18 July, 113-118, 2018.